# ТОКОПЕРЕНОС ПО ЛОВУШЕЧНЫМ СОСТОЯНИЯМ В ОКСИДЕ МОЛИБДЕНА

## Курапцова А.А.

#### Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники г. Минск, Республика Беларусь

### Данилюк А.Л. – канд. физ.-мат. наук, доцент

В данной работе рассмотрен токоперенос по ловушечным состояниям в оксиде молибдена. Приведены результаты моделирования протекания туннельного тока посредством туннелирования между ловушками в оксиде молибдена в зависимости от концентрации ловушек, их энергии и напряженности электрического поля.

В настоящее время возрастает интерес к гетероструктурной фотовольтаике. Оксид молибдена MoO<sub>3</sub> с широкой запрещенной зоной и относительно высокой работой выхода, 3,0-3,3 эВ и 6,2-6,7 эВ соответственно [1], благодаря своей невысокой стоимости и химической стабильности является перспективным полупроводником для применения в перезаряжаемых батареях, конденсаторах, газовых сенсорах, а также в солнечных элементах и устройствах фотокатализа благодаря слабому поглощению электромагнитного излучения и способностью выступать в качестве селективного контакта для дырок, эффективно разделяя генерированные солнечным излучением носители заряда [2].

Оксид молибдена обладает относительно высокой проводимостью благодаря неглубокому залеганию ловушечных состояний и их высокой концентрации.

Вакансии кислорода в оксиде молибдена выступают в роли ловушек, ответственных за транспорт носителей заряда [3]. Наиболее стабильным ловушечным состоянием в оксиде молибдена являются кислородные вакансии. Глубина залегания ловушечных состояний в оксиде молибдена составляет 0,3 эВ ниже дна зоны проводимости и определяет его n-тип проводимости [1]. Концентрация ловушек определяется стехиометрическим составом соединения MoO<sub>3</sub> и составляет порядка 10<sup>19</sup> см<sup>-3</sup>.

Моделирование токопереноса по ловушкам проводилось с использованием модели фононоблегченного туннелирования [4]:

$$J = eN^{2/3}v \tag{1},$$

где *J* – плотность туннельного тока; *е* – заряд электрона; *N* – концентрация ловушек; *v* – частотный фактор.

Частотный фактор v определяется как

$$\nu = \frac{\sqrt{2\pi}\hbar W_t}{m^* s^2 \sqrt{(W_{opt} - W_t)kT}} \sinh\left(\frac{eFs}{2kT}\right) \exp\left(-\frac{W_{opt} - W_t}{2kT}\right) \exp\left(-\frac{2s\sqrt{2m^*W_t}}{\hbar}\right)$$
(2),

$$s = \left(\frac{3\pi N}{4}\right)^{1/3} \tag{3},$$

где  $W_t$  – термическая энергия ловушки,  $W_{opt}$  – оптическая энергия ловушки,  $\hbar$  - редуцированная постоянная Планка,  $m^*$  – эффективная масса носителя заряда (электрона или дырки), F – электрическое поле; s – среднее расстояние между ловушками.

Моделирование туннельного тока было проведено с использованием параметров: 7=300 К.

В результате моделирования были получены зависимости плотности туннельного тока от прикладываемого внешнего поля F при концентрации ловушек  $N=10^{19}$  см<sup>-3</sup> для различных значений  $W_t$  (рисунок 1) и плотность туннельного тока от концентрации ловушек N (рисунок 2) для различных значений F.

Как можно видеть из полученных зависимостей увеличение глубины залегания ловушек в диапазоне от 0,3 эВ до 0,7 эВ приводит к значительному уменьшению плотности тока как показано на рисунке 1. Увеличение концентрации ловушек ведет к уменьшению расстояния между ними и, следовательно, нелинейному возрастанию тока, что можно видеть из рисунка 2. Также изменение напряженности поля в диапазоне от 2.10<sup>5</sup> В/м до 5.10<sup>6</sup> В/м ведет к нелинейному росту тока, не меняя характер его зависимости от концентрации ловушек.



Рисунок 1 – Зависимость плотности тока J от напряженности поля F



Рисунок 2 – Зависимость плотности тока J от концентрации ловушек N

Полученные зависимости определяются высотой и шириной туннельного барьера между ловушками. Рост концентрации ловушек ведет к уменьшению ширины потенциального барьера, а увеличение их энергии – к росту высоты барьера. Данные параметры оказывают противоположное влияние на ток, что может быть использовано для осуществления выбора режима токопереноса.

Таким образом, благодаря возможности достижения высоких значений туннельного тока в оксиде молибдена, он может быть перспективным материалом для применения в устройствах фотокатализа и солнечных элементах за счет высокой концентрации ловушечных состояний и относительно небольшой глубине их залегания.

#### Список использованных источников:

1. Guo Yu. Origin of the high work function and high conductivity of MoO<sub>3</sub> / Yu. Guo and J. Robertson // Applied Physics Letters. – 2014. – Vol. 105, iss. 22. – P. 1-5.

2. Formation of intrinsic and silicon defects in MoO3under varied oxygen partial pressure and temperature conditions: an ab initio DFT investigation. / D. S. Lambert [et al.] // RSC Advances. – 2017. – Vol. 7, iss. 85. – P. 53810-53821.

3. Role of oxygen vacancy defects in the electrocatalytic activity of substoichiometric molybdenum oxide. / R. Kashfi-Sadabad [et al.] // The Journal of Physical Chemistry. – 2018. – Vol. 122, iss. 32. – P. 18212-18222.

4. Механизм транспорта заряда в тонких пленках аморфного и сегнетоэлектрического Hf0.5Zr0.5O2 / Д.Р.Исламов [и др.]. // Письма в ЖЭТФ. – 2015. – Т. 102, № 8. – С. 610 –614.